

陽電子ビームによる表面物性の研究

—半導体内部から最表面構造の探査へ—

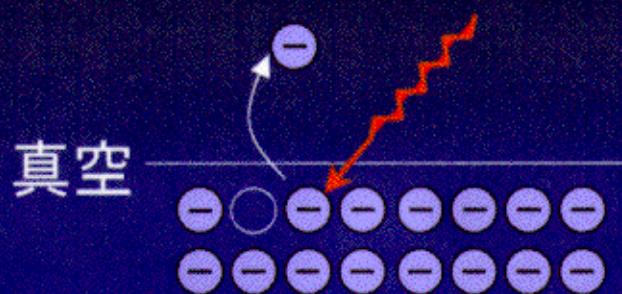
河裾厚男 日本原子力研究所

1. 陽電子スペクトロスコピー
2. 陽電子回折法の開発と応用
3. まとめと今後の展望



陽電子=電子の反粒子 Diracの相対論的量子力学

対生成

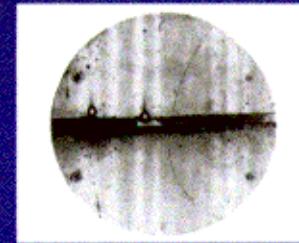


高エネルギー光子

$$E = 2mc^2 = 1.022\text{MeV}$$

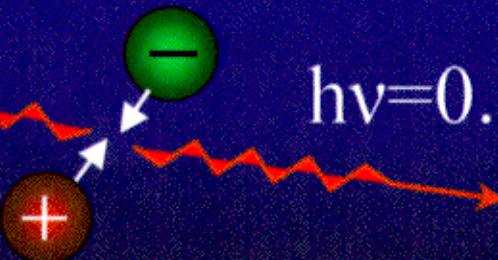
真空の抜穴=陽電子

Anderson
1933年



対消滅

$$0.511\text{MeV}$$



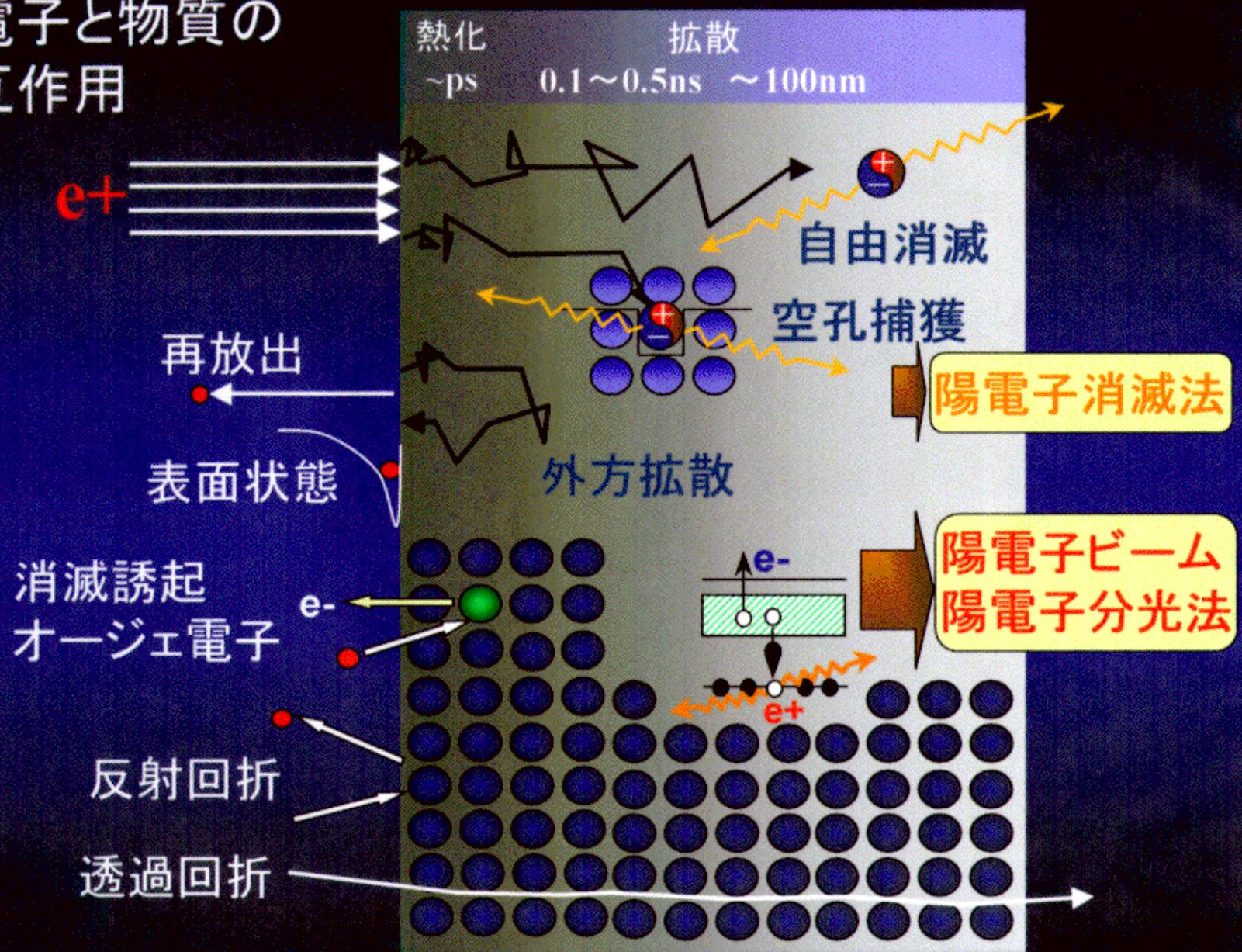
$$h\nu = 0.511\text{MeV}$$

* 放射性同位元素の β^+ 崩壊でも生成

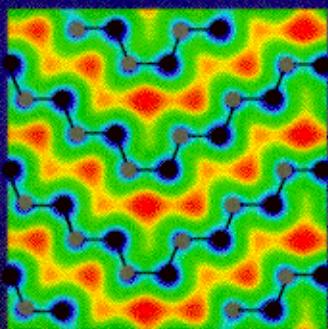
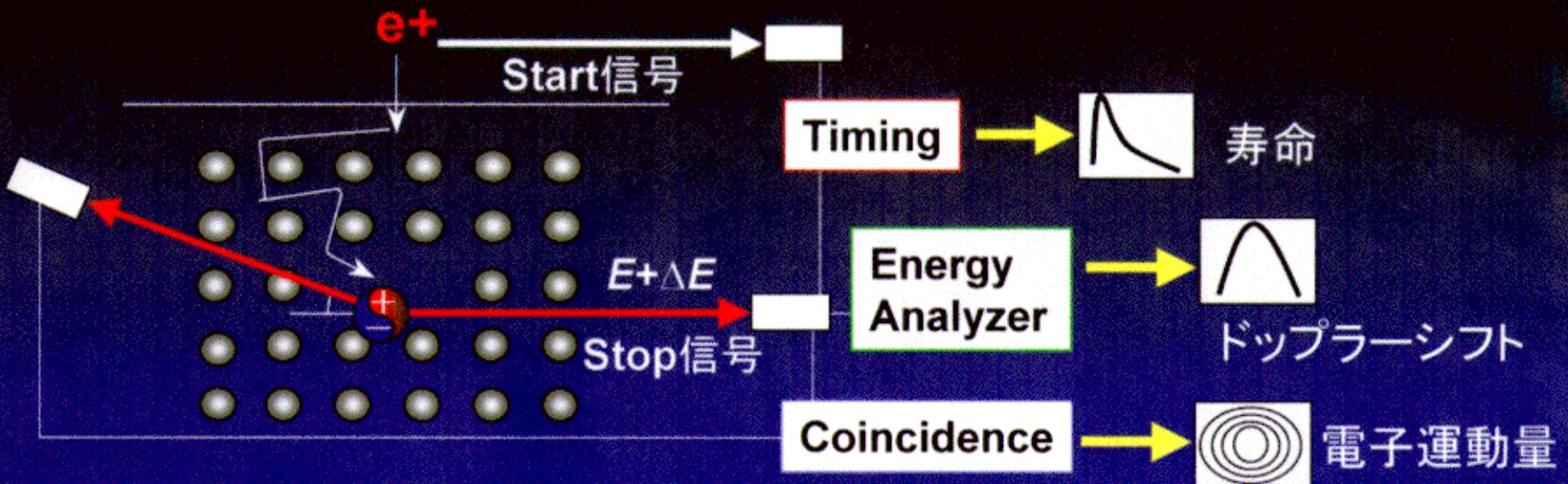
22-Na、64-Cu、58-Co etc



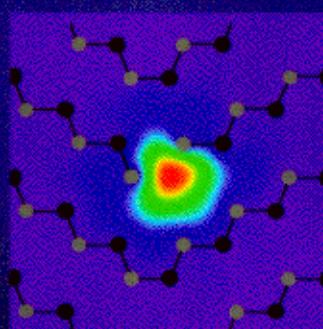
陽電子と物質の相互作用



陽電子消滅法



完全結晶



原子空孔

陽電子寿命

$$1/\tau = \pi r_e^2 c \int |\psi_+(\mathbf{r})|^2 n_-(\mathbf{r}) \gamma d\mathbf{r}$$

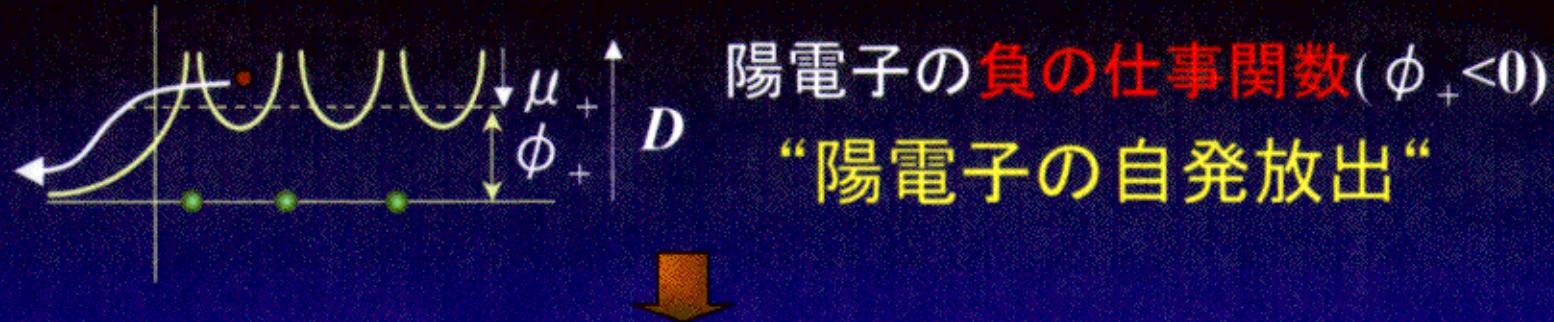
3D電子運動量分布

$$\rho(\mathbf{p}) = \pi r_e^2 c \left| \int \psi_+ \psi_- \exp(-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) d\mathbf{r} \right|^2$$

空孔型欠陥の検出、バンド構造の決定



陽電子ビーム応用



単色陽電子ビーム形成技術の確立

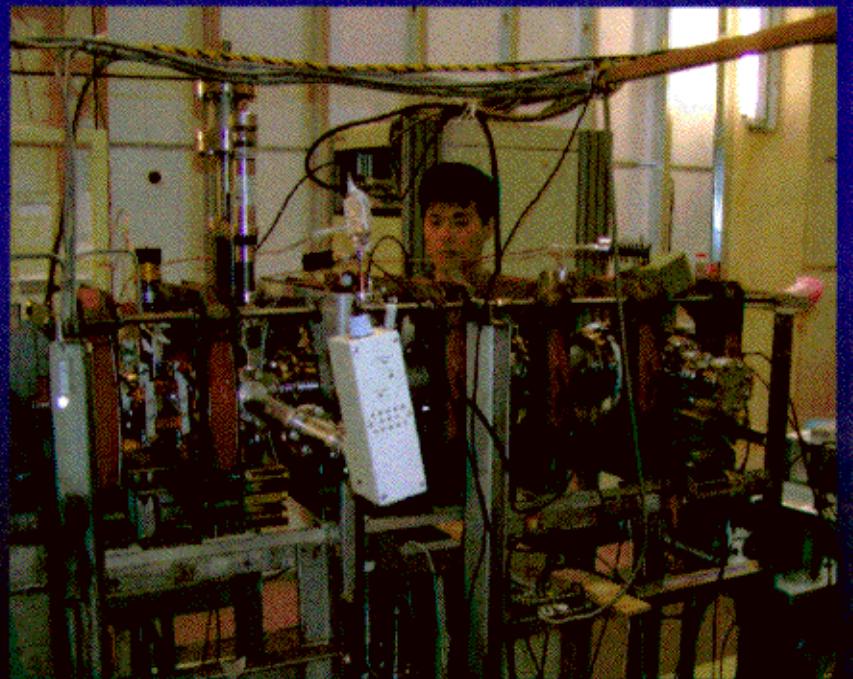
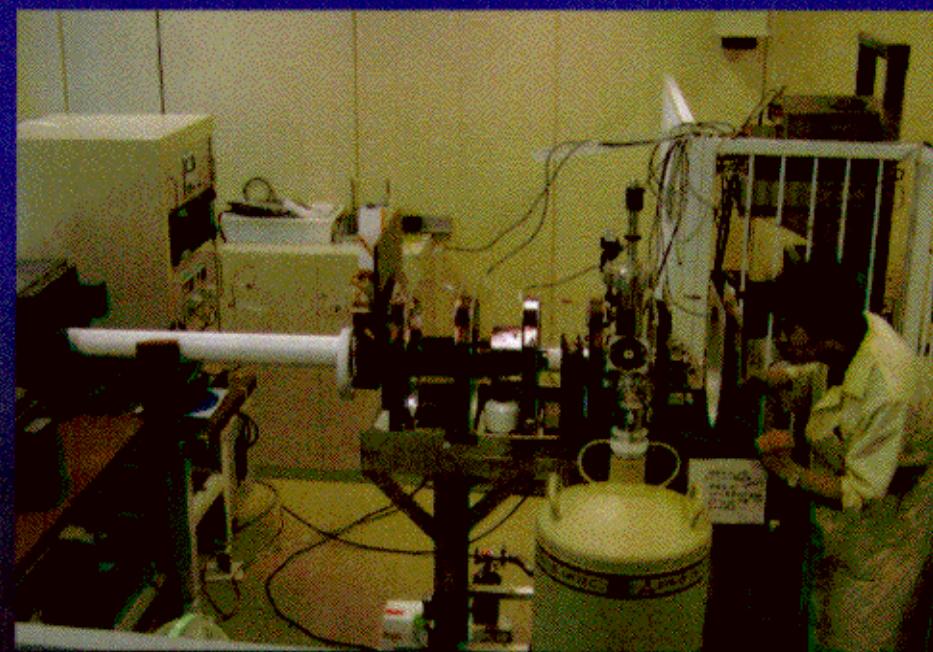
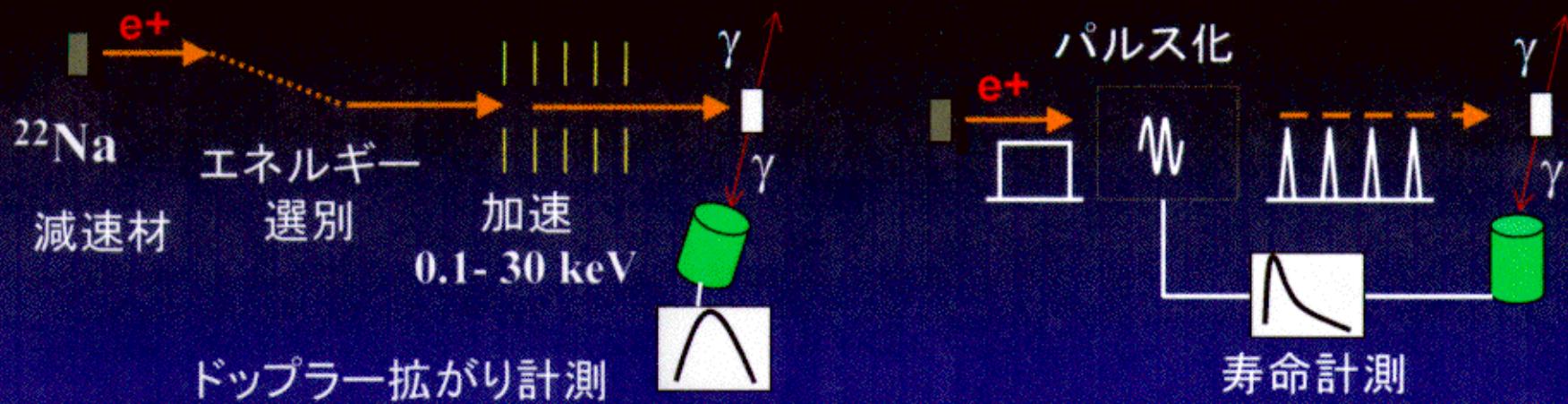
低速陽電子の消滅 → 表面近傍の欠陥構造

陽電子消滅誘起オージェ電子 → 表面元素分析

陽電子の表面全反射 → 最表面構造解析

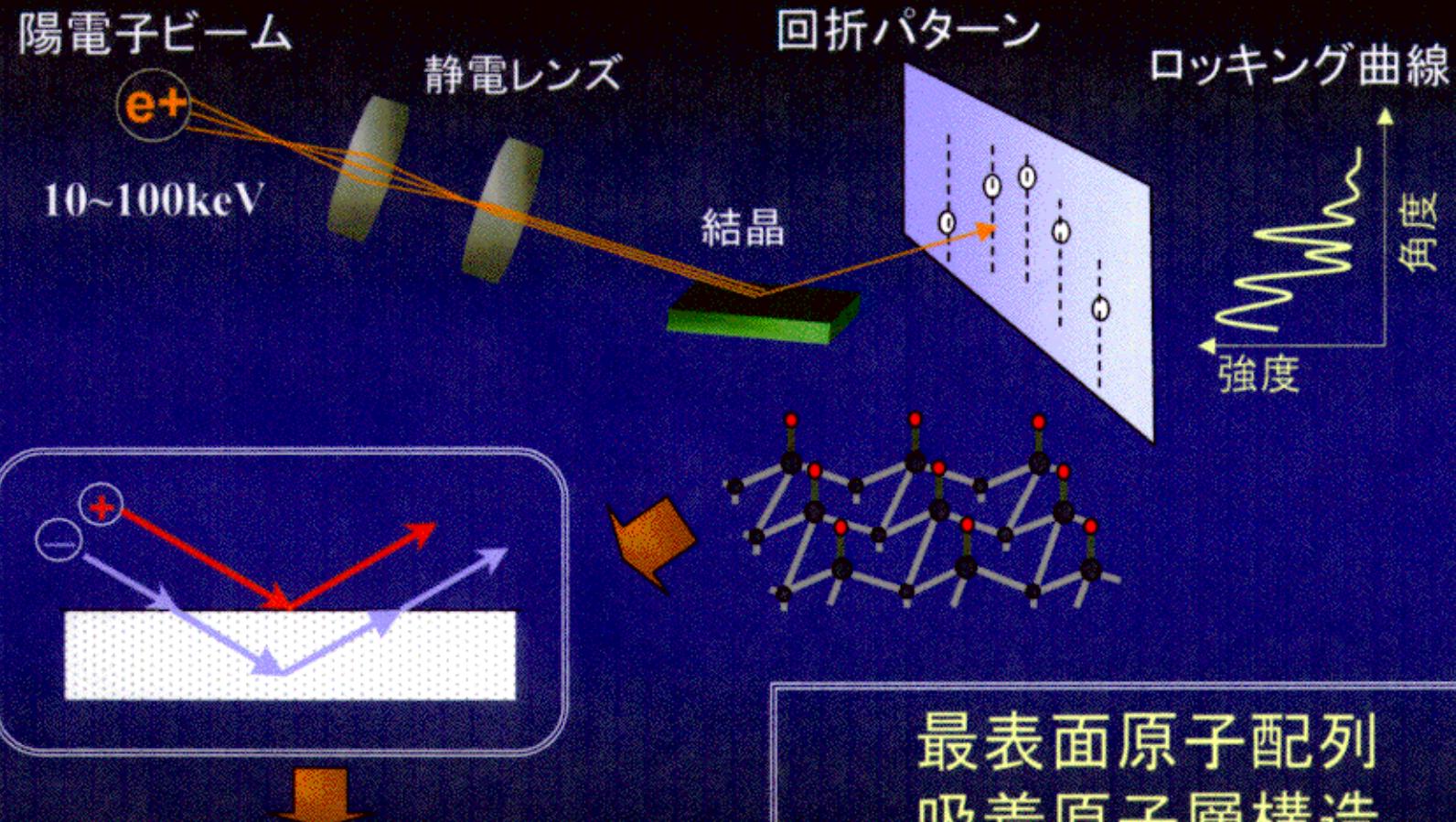


原研における低速陽電子ビーム



JAERI Takasaki Positron Research Laboratory

陽電子回折法(RHEPD)の開発と応用



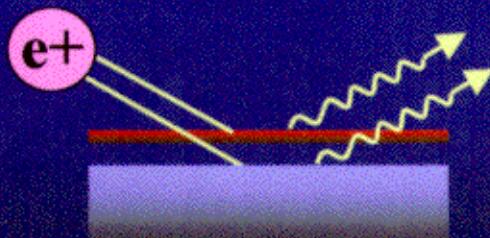
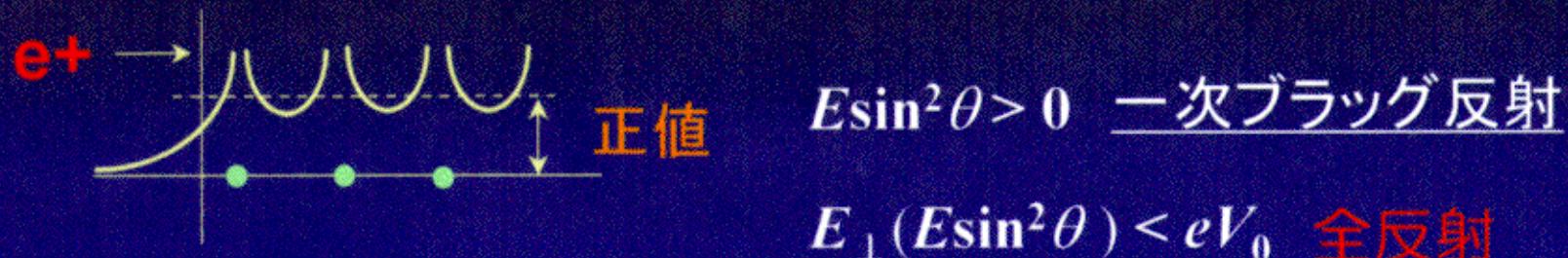
最表面原子配列
吸着原子層構造
表面デバイ温度
金属表面ダイポール障壁



陽電子の全反射が起こる理由

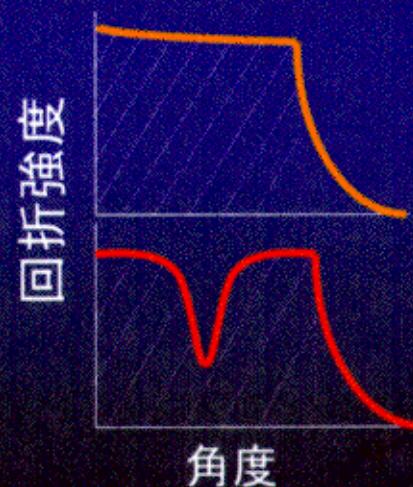
ブラッグの式 $E \sin^2 \theta = 37.5 n^2 / d^2 + eV_0$

原子層間隔 — 結晶ポテンシャル



理想平坦面 →

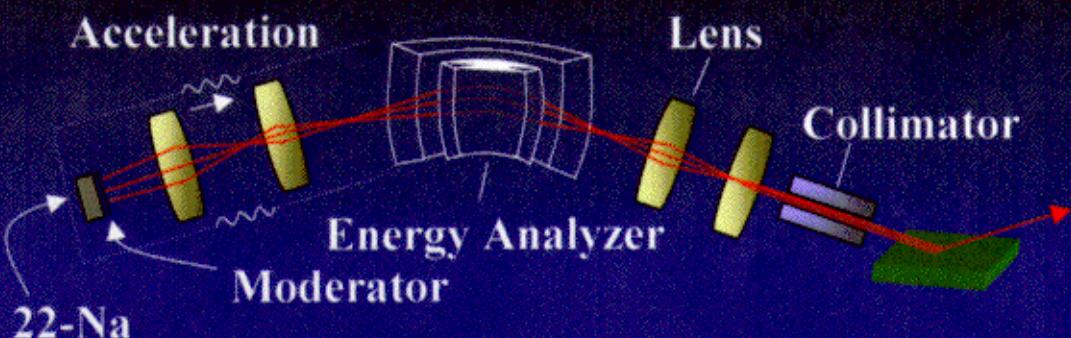
トンネル効果 + 吸着層表面 →
量子干渉効果



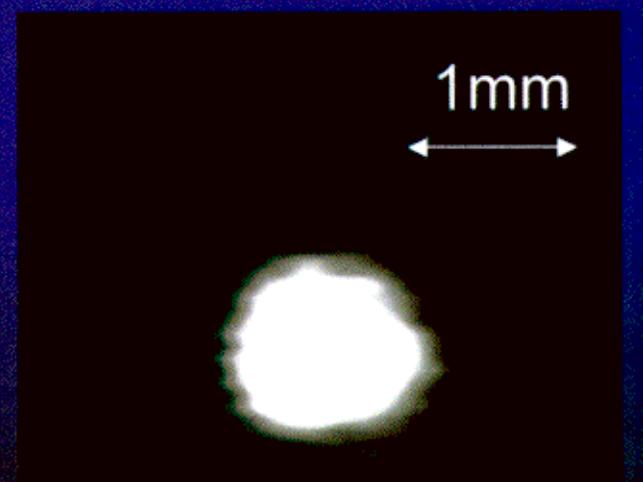
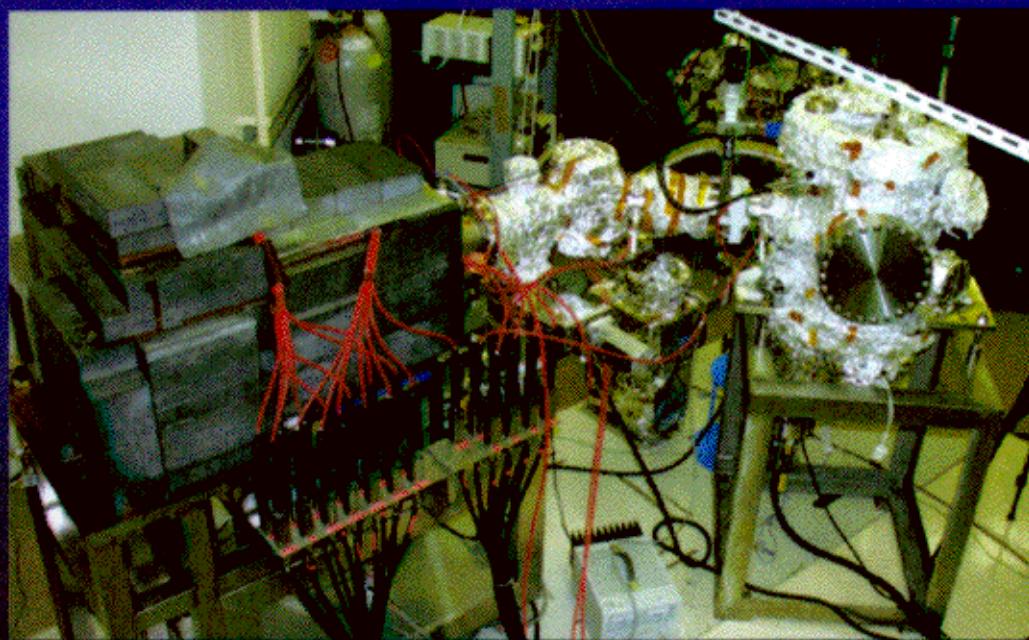
A.Ichimiya, Sol. Stat. Phen. 28&29 (1992/93) 143.



第一世代のRHEPD装置開発 (1998~2002)



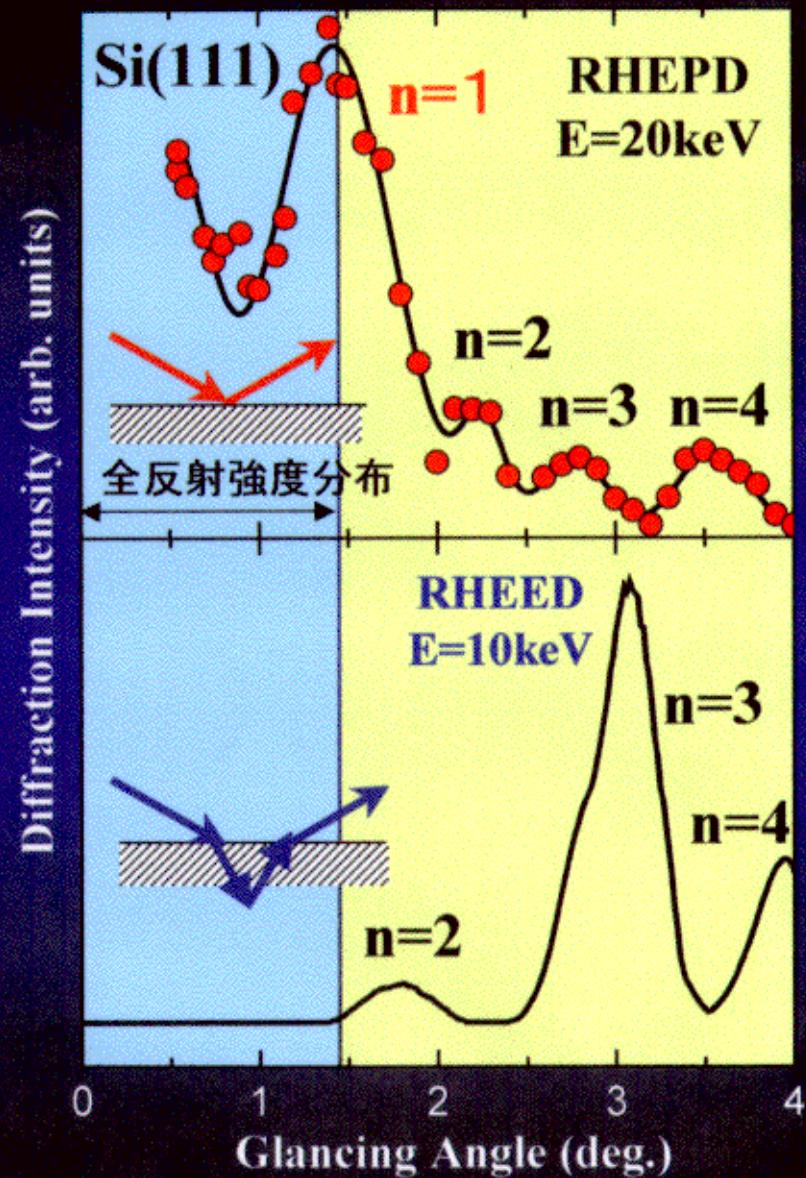
Source strength	370MBq
Energy, E	20keV
ΔE	< 0.1%
$\Delta\theta$	< 0.1°
Diameter	1mm
Intensity	2000e+/sec



3時間→30秒に短縮



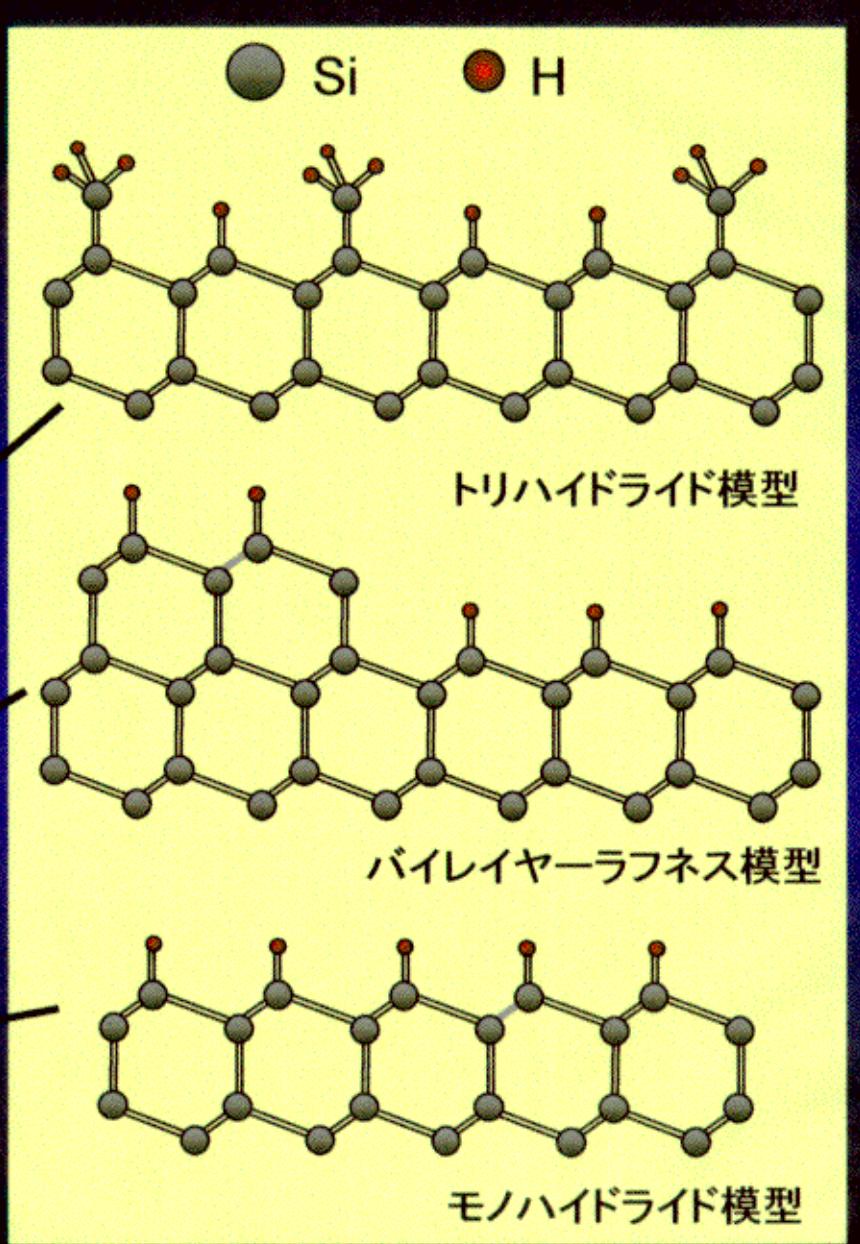
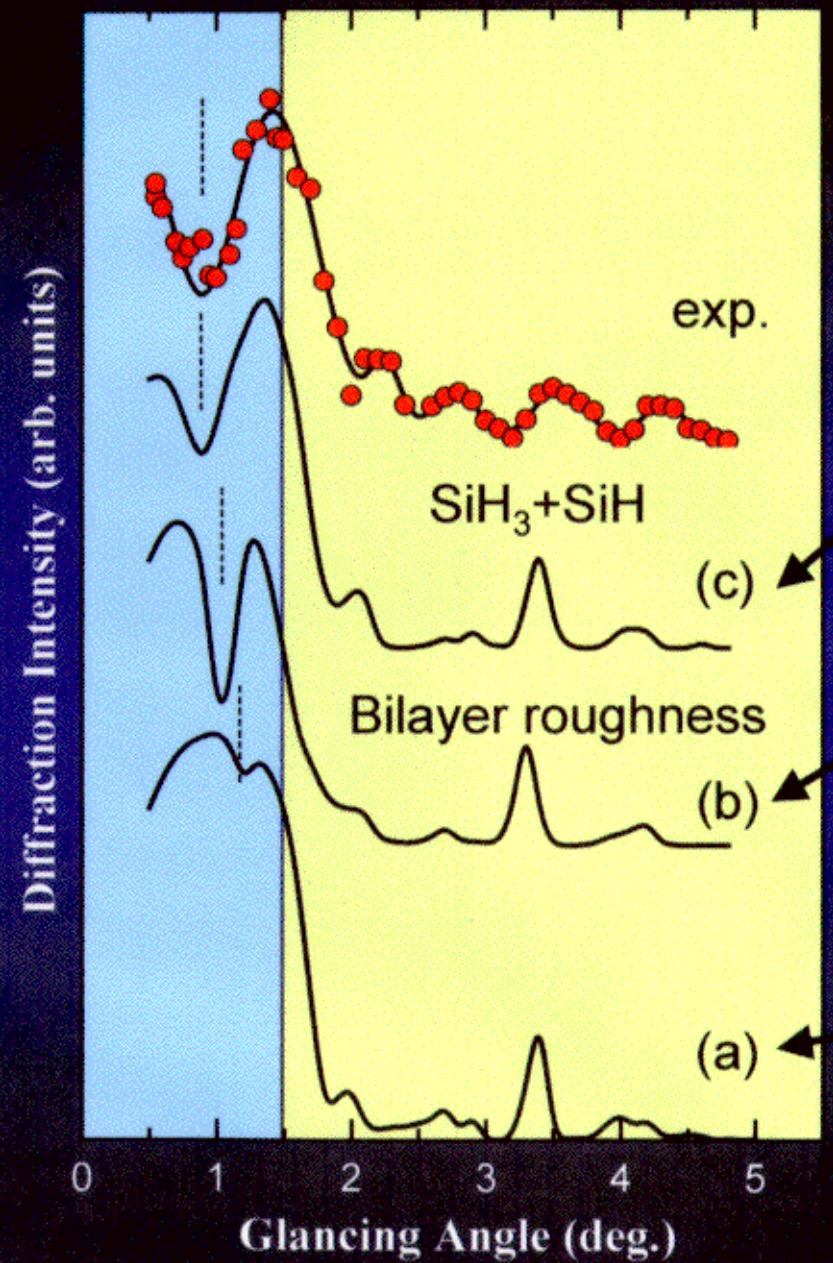




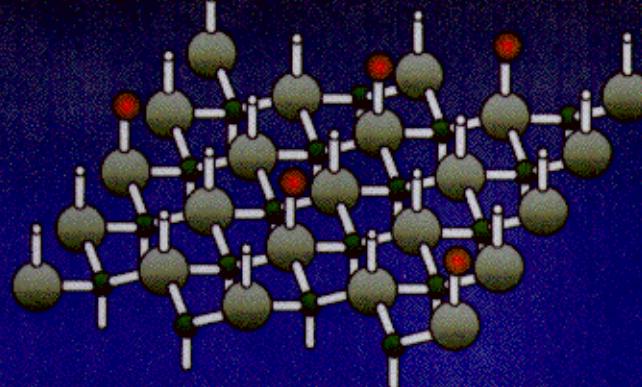
陽電子回折 vs 電子回折

全反射	○	×
n=1反射	○	×
高次反射	○	○
表面周期性	○	○
表面敏感性	○	△
解析難易度	○	×
実験難易度	×	○





干渉効果の発現



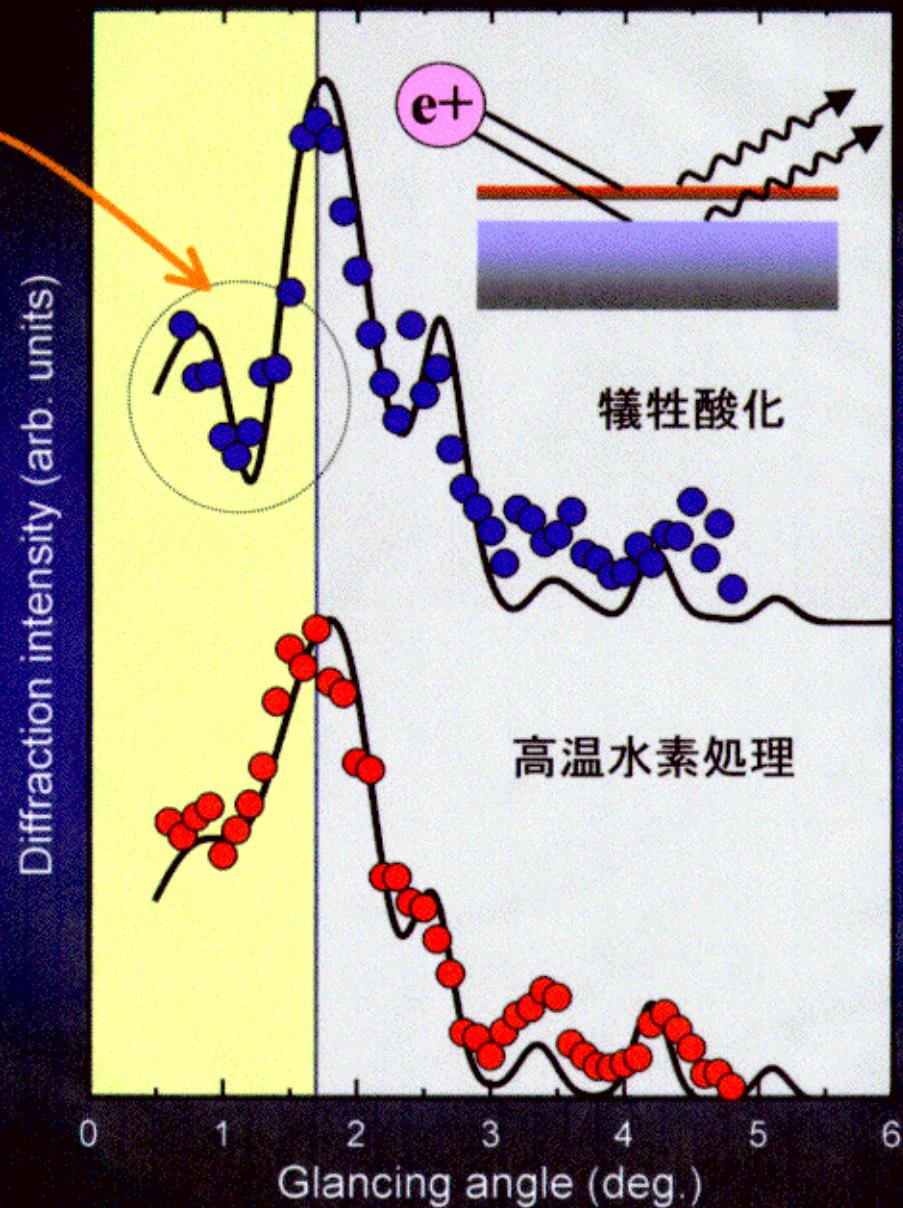
動力学回折理論の計算

Si-O 結合長 $\sim 1.89\text{\AA}$
(LEED研究 1.67\AA)

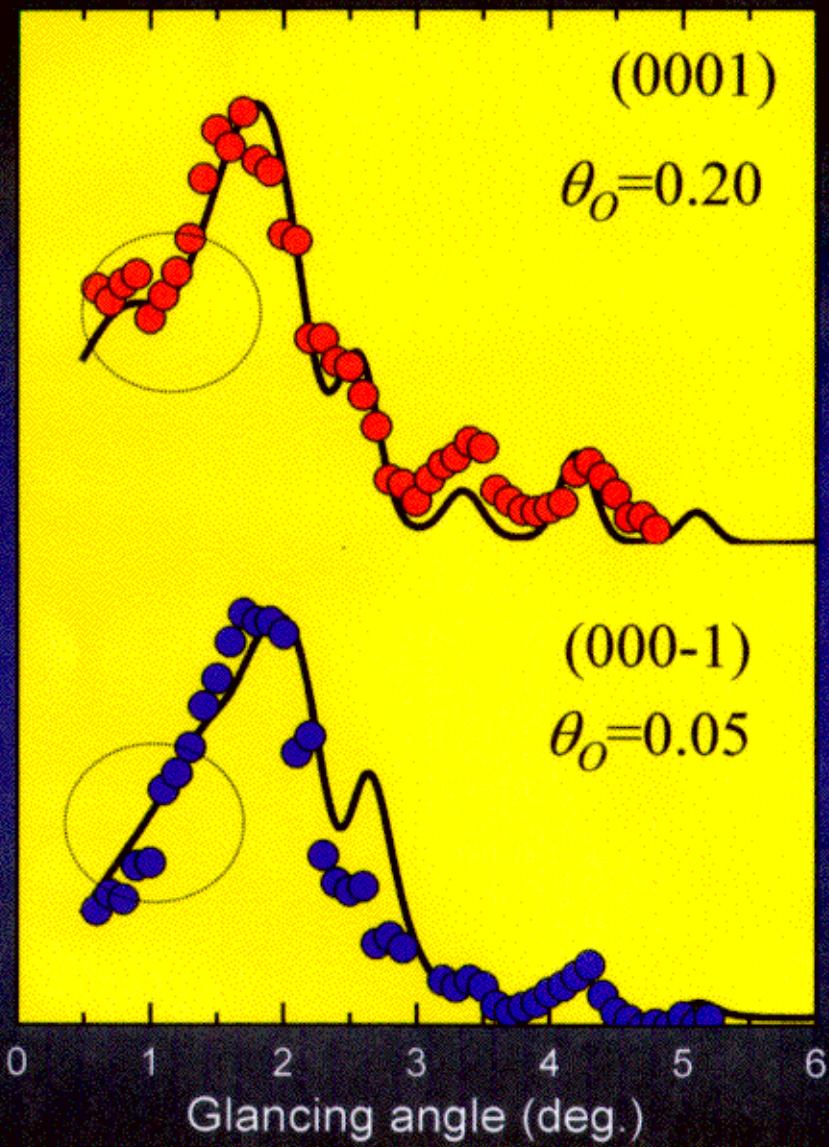
酸素被覆率 …

0.5-0.7 (犠牲酸化)

0.2-0.3 (高温水素処理)



Specular intensity (arb. units)



(0001)

$\theta_O = 0.20$

(000-1)

$\theta_O = 0.05$

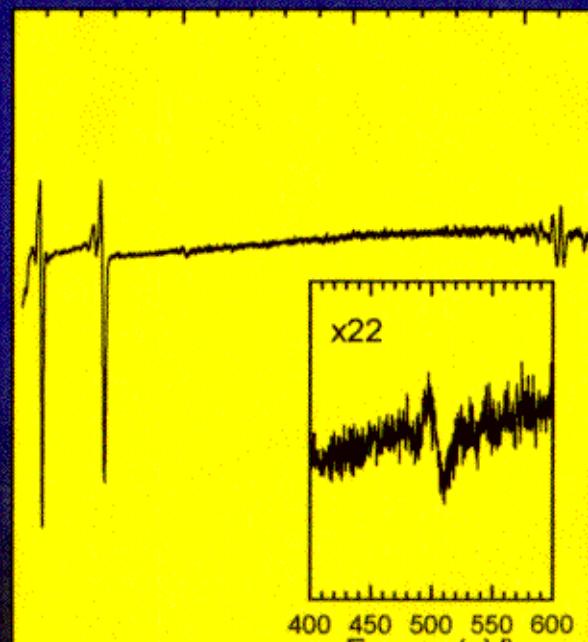
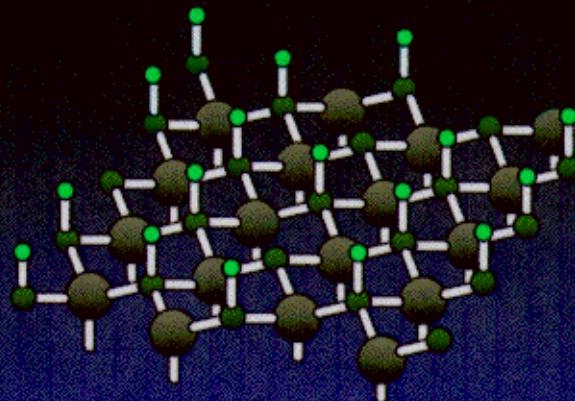
0 1 2 3 4 5 6

Glancing angle (deg.)

dN/dE (arb. units)

0 500 1000 1500

Energy (eV)



x22

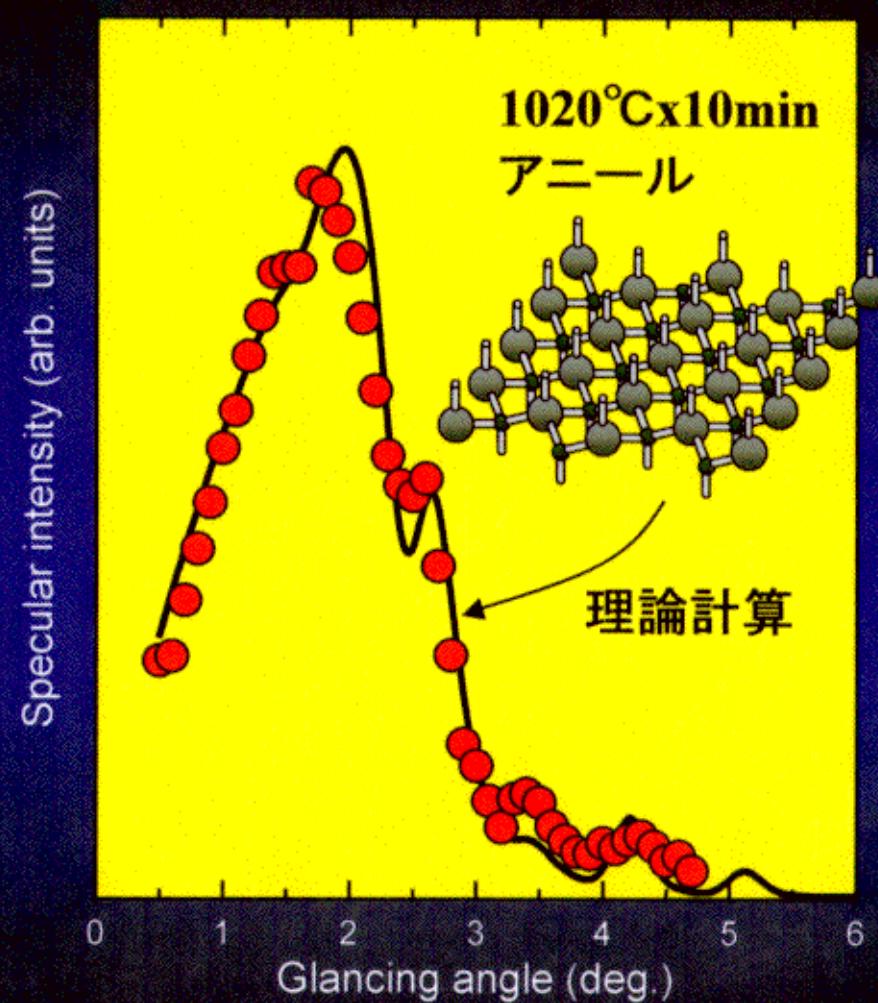
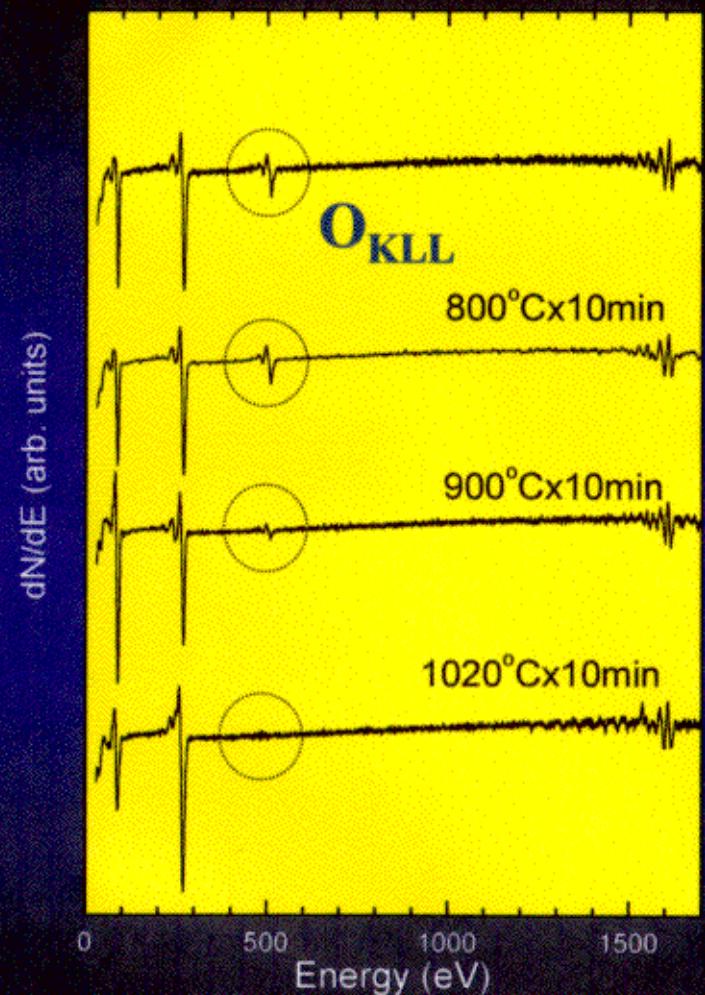
400 450 500 550 600

Energy (eV)



JAERI Takasaki Positron Research Laboratory

熱処理による酸素原子の除去効果



陽電子ビーム技術 ⇒ 内部から最表面の物性研究
局所領域の構造



陽電子顕微技術
マイクロプローブ

陽電子消滅

陽電子回折

消滅誘起組成分析



材料・デバイスの劣化過程や
最表面原子構造を
選択的かつミクロに解明



JAERI Takasaki Positron Research Laboratory

共同研究者：前川雅樹、石本貴幸、伊藤久義、吉川正人
陳志權、岡田漱平（以上原研）
一宮彪彦（名古屋大）

